物理学报 Acta Physica Sinica

Chinese Physical Society

Institute of Physics, CAS

包埋 Pt纳米粒子对金属-半导体-金属结构 ZnO 紫外光电探测器性能的影响

裴佳楠 蒋大勇 田春光 郭泽萱 刘如胜 孙龙 秦杰明 侯建华 赵建勋 梁庆成 高尚

Effect of Pt NPs in the film on the performances of ZnO-based metal-semiconductor-metal structured ultraviolet photodetector

Pei Jia-Nan Jiang Da-Yong Tian Chun-Guang Guo Ze-Xuan Liu Ru-Sheng Sun Long Qin Jie-Ming Hou Jian-Hua Zhao Jian-Xun Liang Qing-Cheng Gao Shang

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 067802 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.067802 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.067802 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I6

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

金属有机物化学气相沉积生长 GaN 薄膜的室温热电特性研究

Room-temperature thermoelectric properties of GaN thin films grown by metal organic chemical vapor deposition

物理学报.2015, 64(4): 047202 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.047202

中子辐照对 AIGaN/GaN 高电子迁移率晶体管器件电特性的影响

Effect of neutron irradiation on the electrical properties of AlGaN/GaN high electron mobility transistors 物理学报.2014, 63(4): 047202 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.047202

新型 AIGaInP 系发光二极管饱和特性与寿命的研究

Investigation of the saturation characteristic and lifetime of the novel AlGaInP lightemitting diodes 物理学报.2014, 63(3): 037201 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.037201

原子层沉积 Al₂O₃/n-GaN MOS 结构的电容特性

Capacitance characteristics of atomic layer deposited Al₂O₃/n-GaN MOS structure 物理学报.2013, 62(19): 197203 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.197203

AlGaN/GaN 高电子迁移率晶体管漏电流退化机理研究

Degradation mechanism of leakage current in AlGaN/GaN high electron mobility transistors 物理学报.2013, 62(15): 157202 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.157202

包埋Pt纳米粒子对金属-半导体-金属结构ZnO 紫外光电探测器性能的影响*

裴佳楠 蒋大勇[†] 田春光 郭泽萱 刘如胜 孙龙 秦杰明 侯建华 赵建勋 梁庆成 高尚

(长春理工大学材料科学与工程学院,长春 130022)(2014年9月10日收到;2014年10月18日收到修改稿)

利用射频磁控溅射设备制备 ZnO 薄膜, 最终制备 ZnO/Pt 纳米粒子/ZnO 结构的金属-半导体-金属型紫 外光电探测器.研究了 Pt 纳米粒子处在 ZnO 薄膜层中的不同深度对金属-半导体-金属型紫外光电探测器 响应性能的影响.结果表明, 探测器的响应度随着 Pt 纳米粒子在 ZnO 薄膜层中所处深度的增大而升高.在 60 V 偏压下, 包埋 Pt 最深的探测器在波长 365 nm 处取得响应度最大值 1.4 A·W⁻¹, 包埋有 Pt 探测器的响应 度最大值为无 Pt 纳米粒子探测器响应度最大值的 7 倍.结合对 ZnO 薄膜表面的表征及探测器各项性能的测试, 得出包埋 Pt 纳米粒子增强器件的响应性能可归因于表面等离子体增强散射.

关键词: ZnO 薄膜, 紫外光电探测器, 表面等离子体, Pt 纳米粒子 **PACS:** 78.66.-w, 72.80.Ey, 73.20.Mf, 73.63.-b **DOI:** 10.7498/aps.64.067802

1引言

近年来, 宽禁带半导体材料 ZnO 的研究已经 引起了人们广泛的关注. ZnO 是一种新型的直接 宽带隙 II-VI 族化合物半导体材料, 其室温禁带宽 度为 3.37 eV. ZnO 原材料资源丰富、价格低廉、无 毒无污染、制备工艺简单. ZnO具有高熔点、高热 稳定性及化学稳定性等优点,是制作紫外光电探测 器的理想材料^[1-3]. 近些年, ZnO 紫外光电探测器 已从单晶薄膜发展到复杂的纳米结构^[4-8].长期以 来, 增强 ZnO 紫外光电探测器的性能一直是主要 问题之一,许多研究致力于解决这个问题^[9-13].近 些年,表面等离子体基础科学的重要性及其实际应 用已经受到了人们的广泛重视[14-18].表面等离子 体可以增强入射光的散射,从而增强光吸收^[19-21], 这使得人们可以利用表面等离子体增强散射来获 得高性能的探测器.如2013年,Shen等^[14]制备出 表面等离子体增强型的ZnO同质结发光设备: 2010 年, Harry和Albert^[22]研究了薄膜的相同深度处不 同粒径 Ag 纳米粒子 (nanoparticles, NPs) 对探测 器响应性能的影响; 2013年,陈洪宇^[23]探讨了在 MgZnO薄膜的相同深度处不同密度 Ag NPs 对探 测器响应性能的影响.但是,Pt NPs在ZnO薄膜 层中的不同深度对金属-半导体-金属(MSM)型紫 外光电探测器响应性能影响的相关研究仍很匮乏. 本文使用射频磁控溅射法制备ZnO薄膜,并将Pt NPs内埋于ZnO薄膜不同深度处,利用这种薄膜结 构制备紫外光电探测器.通过合理设计优化器件结 构,利用Pt NPs的表面等离子体增强散射效应增 强器件对入射光的吸收,从而大幅提高了探测器的 响应性能.

2 实 验

使用射频磁控溅射法制备ZnO薄膜,最终制备SiO₂衬底ZnO/Pt NPs/ZnO结构的MSM型紫外光电探测器. 靶材是纯度为99.99%的ZnO陶瓷靶,

* 吉林省科技发展计划项目(批准号: 201201121, 20120435, 20130204033GX, 20140101052JC)资助的课题.

© 2015 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†]通信作者. E-mail: dayongjiangcust@126.com

溅射气体为高纯的氩气和氧气混合气体, 氩氧气流 比为45:15, 溅射气压为3 Pa, 衬底温度为400°C, 溅射功率为120W, 溅射速率为1.2 nm·min⁻¹.制 备过程如下:第一步, 如图1所示, 分别制备S(0), S(1), S(2), S(3), S(4)五组不同的ZnO薄膜样品, 它们的溅射生长时间依次为3, 2.75, 2.5, 2.25, 2 h; 第二步, 以第一步为基础分别在S(1), S(2), S(3), S(4) 四组ZnO薄膜表面上溅射沉积20 s Pt NPs, 粒径约为10 nm;第三步, 在己沉积的Pt NPs的 S(1), S(2), S(3), S(4) 四组样品表面采用与第一步 相同的ZnO生长条件, 分别溅射生长时间依次为 0.25, 0.5, 0.75, 1 h ZnO薄膜;最后在相同的条件 下, 在五组样品表面生长相同厚度的Au 膜, 通过光 刻工艺, 制备出指长为500 µm, 指间间距为5 µm 的MSM型紫外光电探测器, 如图2 所示.



图 1 (网刊彩色) 五组探测器 S(0), S(1), S(2), S(3), S(4) 的成膜过程



图 2 (网刊彩色) (a), (b), (c), (d), (e) 分别为制备的 五组探测器 S(0), S(1), S(2), S(3), S(4) 的结构图 它 们的薄膜结构分别为: S(0)为ZnO (3 h); S(1)为ZnO (2.75 h)/Pt NPs/ZnO (0.25 h); S(2)为ZnO (2.5 h)/Pt NPs/ZnO (0.5 h); S(3)为ZnO (2.25 h)/Pt NPs/ZnO (0.75 h); S(4)为ZnO (2 h)/Pt NPs/ZnO (1 h)

3 结果与讨论

图 3 为 S(0), S(1), S(2), S(3), S(4) 五 组 ZnO/Pt NPs/ZnO结构的 X 射线衍射 (XRD) 图 谱. 由图中可以观察到五组样品只在 34.4° 附近出 现一个衍射峰,且为六角结构 ZnO的 (002) 衍射 峰,五组样品的半高宽均小于 0.5°. 这表明所制备 的五组样品的薄膜为六角结构,具有 *c* 轴择优取向, 而相对较窄的 XRD 半高宽则表明五组样品的薄膜 的结晶质量较好.从图中可以看出,五组样品薄膜的峰位、半高宽重合,说明五组样品薄膜生长过程中条件控制精准,薄膜质量差别很小,有利于对后期制备的探测器的各项性能进行对照讨论.



图 3 (网刊彩色) 五组器件薄膜系统的 XRD 图谱



图 4 (网刊彩色) (a), (b) 分别为五组器件薄膜系统的吸收透射光谱

图4为S(0), S(1), S(2), S(3), S(4)五组 ZnO/Pt NPs/ZnO结构的薄膜系统吸收透射光 谱. 从图4(a)中可以看出,五组样品的吸收峰均 在365 nm左右,且无Pt NPs的S(0)组吸收峰值最 小,吸收峰值大小为S(1) > S(2) > S(3) >S(4) > S(0). 从图4(b)中观察到Pt NPs的存在对薄膜的 透射率影响很大,有Pt NPs的薄膜透射率很低.由 图谱可以看出,Pt NPs的存在可显著增强光吸收 能力,尤其是在紫外光波段.有Pt NPs的 S(1), S(2),S(3),S(4)四组样品在紫外波段的吸收能力 随着Pt NPs在ZnO薄膜层中所处深度的增大而 升高.

图 5 为S(0), S(1), S(2), S(3), S(4) 五组 MSM 结构探测器的 *I-V* 特性曲线.在10 V偏压下,测得 的S(0) 器件暗电流约为1.0 nA,而S(1), S(2), S(3), S(4) 四组暗电流也均约为1.0 nA,说明 Pt NPs没 有引起器件暗电流的明显增大.这是由于器件 ZnO 薄膜层可被理解为一个体电阻,当在体电阻的上表面接通电路时,由于体电阻内部电阻比外表面大,所以电流必然从体电阻的上表面通过,因此,Pt NPs 所处位置对器件暗电流的影响小.



图 5 (网刊彩色) 五组探测器的 I-V 特性曲线



图 6 (网刊彩色) 五组探测器在 60 V 偏压下的光谱响应 特性曲线

图 6 为 S(0), S(1), S(2), S(3), S(4) 五组紫外探 测器在 60 V偏压下的光谱响应特性曲线. 从图中 可明显看出, 无 Pt NPs 的 S(0) 组响应度(*R*) 值在 紫外光波段最小. 有 Pt NPs 的 S(1), S(2), S(3), S(4) 四组样品在紫外波段的响应度随着 Pt NPs 在 ZnO 薄膜层中所处深度的增大而升高, 即 S(1) > S(2) > S(3) > S(4). 这一规律与图 3 中吸收率的大 小规律一致.



图7 (网刊彩色) Pt NPs 在 ZnO 层中的散射效应

表面等离子体散射效应的机理已在已有文献 中做了描述^[24],而对于包埋Pt NPs增强了探测器 光响应性能的现象,合理的解释是表面等离子体散 射增强了薄膜光吸收,从而改善了探测器的响应性 能.图7显示了一个Pt NPs在ZnO层中的散射效 应.表面等离子体散射效应将会产生大的散射横截 面^[25],从而增强入射光的散射,使更多的光散射在 ZnO薄膜中,增加了ZnO表层的光吸收,促进了更 多电子空穴对的产生,因此器件的光响应性能得到 改善.

根据米氏定理, 散射横截面*C*_{sca}可以由方程 (1)计算^[25]:

$$C_{\rm sca} = \frac{1}{6\pi} \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^4 |\alpha|^2, \qquad (1)$$

(1) 式中 λ 是入射光波长 $\pi = 3.14$, α 是球形和椭球 形金属纳米粒子极化率参数, 可以由方程 (2) 计算:

$$\alpha = 3V \left[\frac{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_m} - 1}{\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_m} + 2} \right], \qquad (2)$$

(2) 式中V是Pt NPs的体积, $\varepsilon_p 和 \varepsilon_m 分别为金属$ $粒子和ZnO的介电函数,因此,在特定波长下,<math>\varepsilon_p$ 和 ε_m 为常数. α 正比于纳米颗粒的体积(V),因此 C_{sca} 与NPs的体积平方成正比. 根据方程(2),大 尺寸比小尺寸的纳米粒子散射效率更高. 但 S(1), S(2), S(3), S(4) 四组器件中包埋的Pt NPs是等数 量、等粒径的,因此四组器件中所包埋的Pt NPs的 散射横截面 C_{sca} 是相等的. 如图8所示,当有光源 照射在有Pt NPs探测器时,射入到ZnO薄膜层中 的光线会在Pt NPs表面发生大量散射,散射出的 光线会在介质中其他的Pt NPs表面再次发生散射, 散射的光线将会在介质中获得一定角度继续传播, 从而实际上增加了光程长度L.包埋有Pt NPs的 四组器件的实际光程长度分别为L1,L2,L3,L4, 随着Pt NPs包埋深度的增加,光程长度将随着增 加,即:L1 < L2 < L3 < L4.而有Pt NPs的四组 器件的光程长度与无Pt NPs S(0)探测器L0相比, 必然为L0 < L1 < L2 < L3 < L4.光程长度增加 使 ZnO表层对光吸收增强,促进了更多的电子空穴 对产生,从而器件获得了更高的响应性.所以探测 器的响应度随着Pt NPs层在ZnO薄膜层中所处深 度的增大而升高.



图 8 (网刊彩色)入射光线会在 Pt NPs 表面发生大量散射

4 结 论

为了提高ZnO基紫外光电探测器的响应性能, 本文利用射频磁控溅射技术沉积ZnO薄膜,并制 备了ZnO/Pt NPs/ZnO结构的MSM型紫外光电 探测器.将ZnO薄膜与表面等离子体结合起来制 备的器件的响应性能得到改善,同时,其暗电流未 有大的改变.通过详细分析ZnO薄膜的XRD图 谱、吸收透射光谱和器件的*I-V*特性曲线以及光谱 响应特性曲线,可以得出探测器优良的响应性能 归因于Pt NPs表面等离子体散射增强效应.同时, MSM型紫外光电探测器的响应度随着Pt NPs在 ZnO薄膜层中所处深度的增大而升高,器件的响应 度最大值提高7倍,这说明ZnO/Pt NPs/ZnO结构 的设计对于提高紫外光电探测器的探测性能有很 大的帮助,可促进一种技术成熟的、性能优异的紫 外光电探测器走出实验室,应用到实际生活中.

参考文献

[1] Hahn E E 1951 J. Appl. Phys. 22 855

- [2] Razeghi M, Rogalski A 1996 J. Appl. Phys. 79 7433
- [3] Liu K W, Sakurai M, Aono M 2010 Sensors-Basel. 10 8604
- [4] Qin J M, Tian L F, Zhao D X, Jiang D Y, Cao J M, Ding Y, Guo Y 2011 *Acta Phys. Sin.* **60** 107307 (in Chinese)
 [秦杰明, 田立飞, 赵东旭, 蒋大勇, 曹建明, 丁摇, 郭摇 2011 物理学报 **60** 107307]
- [5] Wu P, Zhang J, Li X F, Chen L X, Wang L, Lü J G 2013
 Acta Phys. Sin. 62 018101 (in Chinese) [吴萍, 张杰, 李 喜峰, 陈凌翔, 汪雷, 吕建国 2013 物理学报 62 018101]
- [6] Jiang D Y, Shan C X, Zhang J Y, Lu Y M, Yao B, Zhao D X, Zhang Z Z, Shen D Z, Yang C L 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 42 025106
- [7] Liu M J, Kim H K 2004 Appl. Phys. Lett. 84 173
- [8] Cao M M, Zhao X R, Duan L B, Liu J R, Guan M M, Guo W R 2014 Chin. Phys. B 23 047805
- [9] Yu J, Shan C X, Huang X M, Zhang X W, Wang S P, Shen D Z 2013 J. Phys. D: Appl. Phys. 46 305105
- [10] Chen Y, Ko H J, Hong S K, Yao T 2000 Appl. Phys. Lett. 76 559
- [11] Xue S W, Zu X T, Zhou W L, Deng H X, Xiang X, Zhang L, Deng H 2008 J. Alloys Compd. 448 21
- [12] Li M, Anderson W, Chokshi N, Deleon R L, Tompa G 2006 J. Appl. Phys. 100 053106
- [13] Ali G M, Chakrabarti P 2010 Appl. Phys. Lett. 97 031116
- [14] Shen H, Shan C X, Qiao Q, Liu J S, Li B H, Shen D Z 2013 J. Mater. Chem. C 1 234
- [15] Ren Y D, Hao S J, Qiu Z Y 2013 Acta Phys. Sin. 62
 147302 (in Chinese) [任艳东, 郝淑娟, 邱忠阳 2013 物理学 报 62 147302]
- [16] Kwon M K, Kin J Y, Kim B H, Park I K, Cho C Y, Byeon C C, Park S J 2008 Adv. Mater. 20 1253
- [17] You J B, Zhang X W, Zhang S G, Yin Z G, Wang J X, Yin Z G, Tan H R, Zhang W J, Chu P K, Cui B, Wowchak A M, Dabiran A M, Chow P P 2010 Appl. Phys. Lett. 96 201102
- [18] Chang D E, Sørensen A S, Demler E A, Lukin M D 2007 Nat. Phys. 3 807
- [19] Bohren C F 1998 In Absorption and Scattering of Light by Small Particles (2nd Ed.) (New York: Wiley-Interscience) p93
- [20] Stuart H R, Hall D G 1998 Phys Rev. Lett. 80 5663
- [21] Stuart H R, Hall D G 1998 Appl. Phys. Lett. 73 3815
- [22] Harry A A, Albert P 2010 Nat. Mater. 9 205213
- [23] Chen H Y 2013 Ph. D. Dissertation (Changchun: Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [陈 洪宇 2013 博士学位论文 (长春:中国科学院长春光学精密 机械与物理研究所)]
- [24] Steven S 2011 Phys. Today **64** 39
- [25] Li D B, Sun X J, Song H, Li Z, Chen Y R, Hong J, Miao G Q 2012 Adv. Mater. 24 845

Effect of Pt NPs in the film on the performances of ZnO-based metal-semiconductor-metal structured ultraviolet photodetector^{*}

Pei Jia-Nan Jiang Da-Yong[†] Tian Chun-Guang Guo Ze-Xuan Liu Ru-Sheng Sun Long Qin Jie-Ming Hou Jian-Hua Zhao Jian-Xun Liang Qing-Cheng Gao Shang

(School of Materials Science and Engineering, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China) (Received 10 September 2014; revised manuscript received 18 October 2014)

Abstract

In this paper, by a radio frequency magnetron sputtering equipment, the ZnO/Pt nanoparticles/ZnO thin film structure is fabricated on a SiO₂ substrate via three-step. And the metal-semiconductor-metal (MSM) structured ultraviolet (UV) photodetectors are built up. It is studied that the Pt nanoparticles in different depths of the layer of ZnO thin film affect the photoresponse performances of the MSM ultraviolet photodetector. The results show that the responsivity of the detector increases as Pt nanoparticles in ZnO thin film layers augment with the depth increasing. The responsivity of device is measured under 60 V bias, its photoresponse peak is at 365 nm, and the peak photoresponse is $1.4 \text{ A}\cdot\text{W}^{-1}$, which is enhanced by 7 times that of the photodetector without Pt NPs. Considering the performance analyses of ZnO films and the photodetectors, it is clear that the excellent performances of the detector with Pt NPs in the film can result from the scattering of Pt NPs.

Keywords: ZnO films, ultraviolet photodetector, surface plasmon, Pt nanoparticles PACS: 78.66.-w, 72.80.Ey, 73.20.Mf, 73.63.-b DOI: 10.7498/aps.64.067802

^{*} Project supported by the Technology Research and Development Program of Jilin Provice, China (Grant Nos. 201201121, 20120435, 20130204033GX, 20140101052JC).

[†] Corresponding author. E-mail: dayongjiangcust@126.com